

ナノテクノロジープラットフォーム
研究支援に提供する設備一覧
【微細加工プラットフォーム】

機関名	設備(設備群)名	仕様	備考
香川大学	電子線描画装置	エリオニクス社製電子線描画装置 ELS-7500EX 加速電圧: 50kV、30kV、20kV 描画可能な最小線幅10nm フィールドつなぎ精度50nm 以下 ミカサ社製スピニングコート 1H-DX2	
香川大学	マスクレス露光装置	大日本科研社製 マスクレス露光装置 MX-1204 DMDによるパターン生成露光、 露光サイズ150mm角、 最小描画面素1 μ m、 アライメント精度 \pm 0.15 μ m ミカサ社製スピニングコート 1H-DX2	
香川大学	マスクアライナ	ミカサ社製片面マスクアライナ MA-10型 ミカサ社製スピニングコート 1H-DX2	
香川大学	真空蒸着装置	ULVAC社製真空蒸着装置 VPC-1100 試料台: 2.5インチ 膜厚: 0.001 μ m \sim 膜厚制御: 0.01nm/s	
香川大学	デュアルイオンビームスパッタ装置	ハンノック社製デュアルイオンビームスパッタ装置 4in-IBS 熱陰極型イオン源: 2基 (:50 \sim 1000eV) 基板加熱温度: 最大700 $^{\circ}$ C	
香川大学	イオンシャワー	エリオニクス社製イオンシャワー EIS-200ER イオン銃: 電子サイクロトロン共鳴(ECR)型 イオン化ガス: Ar 加速電圧: 30V \sim 3000V連続可変	
香川大学	触針式表面形状測定器	アルバック社製 触針式表面形状測定器 Dektak8 測定分解能: 最小0.1nm 測定再現性: 1nm以下	
香川大学	走査電子顕微鏡(EDS付き)	JEOL社製走査電子顕微鏡(EDS付き) JSM-6060-EDS 加速電圧: 30kV、EDS元素分析 JEOL社製イオンコータ JFC-1600	
香川大学	白色干渉式非接触三次元形状測定器	ブルカー・エイックスイス社製 白色干渉式三次元形状測定器 NT91001A-in motion in-situ駆動観察	
香川大学	レーザー式非接触三次元形状測定器	三鷹光器社製 レーザー式三次元形状計測器 NH-3N 測定分解能: 0.1 \times 0.1 \times 0.01 μ m	
香川大学	デジタルマイクロスコープ	ハイロックス社製 高倍率デジタルマイクロスコープ KH-7700	
香川大学	ダイシングマシン	DISCO社製ダイシングマシン DAD3220 ウエハ厚み: 最大1mm以下	
香川大学	電子測定器	カール・スーエ社製ウェハプローバ PM5 エスピエス(株) 4深針型薄膜抵抗率計 KS-TC-40-SB-VR	
香川大学	膜厚測定器	溝尻光学社製エリブソメータ DHA-XA/M8 膜厚と屈折率を測定可能	